Fax:045 316-3710

2001年 2月28日(水) 1:01

世界知的所有権機關 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6

(11) 国際公開番号 A1

WO00/13217

H01L 21/304, 21/308, C23F 1/16

(43) 国際公開日

2000年3月9日(09.03.00)

(21) 国際出願番号 (22) 国際出願日

(30) 優先権データ

特願平10/245616

特職平10/351188

PCT

PCT/JP99/04694 1999年8月31日(31,08,99)

松沢 纯(MATSUZAWA, Jun)fJP/JP1 〒317-8555 茨城県日立市東町四丁目13番1号

自立化成工業株式会社 山崎事業所内 [baraki, (JP) 本間書夫(HONMA, Yoshio)[JP/JP]

近藤誠一(KONDOH, Selichi)[JP/JP]

〒185-0014 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社 日立製作所 中央研究所内 Tokyo, (JP)

(74) 代理人 弁理士 宮田和子, 外(TOMITA, Kazuko et al.) 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目9-10

機紙HSビル7階 Kanagawa, (JP)

(HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.)(JP/JF) 株式会社 日立製作所(HITACHI, LTD.)[JP/JP]

(71) 出願人 (米國を除くすべての程定圏について)

〒163-0449 東京部新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo, (JP) 〒100-8220 東京都千代留区神田駿河台四丁目6番地 Tokyo, (JP) (72) 発明者;および

日立化成工業接式会計

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

内田 削(UCHIDA, Takeshi)[JP/JP] 星野鉄哉(HOSHINO, Tetsuya)[JP/JP]

上方康雄(KAMIGATA, Yasuo)[JP/JP]

寺崎裕樹(TERAZAKI, Hiroki)[JP/JP]

〒305-4247 茨城県つくば市和台48番

日立化成工業株式会社 総合研究所內 Ibaraki. (JP)

CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HU, ID, II IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI

AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA,

物計 (BF, BJ, CF, CO, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), ュ ーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

添什公服書籍

(81) 指定隊

国際部容科会本

ABRASIVE LIQUID FOR METAL AND METHOD FOR POLISHING

1998年8月31日(31.08.98)

1998年12月10日(10.12.98)

(54) 発明の名称 金属用研磨液及び研磨方法

(57) Abstract

An abrasive liquid for a metal comprising (1) an oxidizing agent for a metal, (2) a dissolving agent for an oxidized metal, (3) a first protecting film-forming agent such as an amino acid or an azole which adsorbs physically on the surface of the metal and/or forms a chemical bond, to thereby form a protecting film, (4) a second protecting film-forming agent such as polyacrylic acid, polyamido acid or a sait thereof which assists the first protecting film-forming agent in forming a protecting film and (5) water; and a method for polishing.